Другим типом интересных наноструктур с широким потенциалом применения являются углеродные нанотрубки. Они представляют собой графитовые сетки, свернутые в трубки. Однослойная нанотрубка может иметь диаметр 2 нм и длину 100 мкм, что делает ее структурой, способной служить нанопроволокой. Многостенные нанотрубки могут содержать от нескольких до нескольких десятков одностенных нанотрубок, вставленных друг в друга. Широкие перспективы использования нанотрубок в материаловедении открываются при капсулировании внутрь углеродных нанотрубок сверхпроводящих кристаллов, что позволяет изолировать сверхпроводящие материалы от вредного воздействия внешней среды.

Литература

1. Витязь, П.А. Фуллерены и фуллереносодержащие материалы / П. А. Зезин, Э. М. Шпилевский, В. Ф Стельмах. – Сборник научных трудов, Минск: БГУ, 2001. – С. 5–26.

2. Кужир, П. Г. Физика конденсированных сред / П. Г. Кужир, А. А. Баранов, А. П. Каравай, Н. П. Юркевич. – Минск: Технопринт, 2002. – С. 155–169.

3. Леонович, С. Н. Основы физики твердого тела для строителей / С. Н. Леонович, С. И. Петренко. – Минск: БНТУ, 2010. – С. 202–217.

УДК 620.130

Гистерезисная интерференция магнитных полей

Павлюченко В. В., Дорошевич Е. С. Белорусский национальный технический университет Минск, Республика Беларусь

Представлены расчетные начальные и гистерезисные ветви электрического напряжения датчика, прямо пропорциональные остаточной намагниченности магнитного носителя (МН). Воздействие на МН осуществляли импульсными магнитными полями двух источников. Построены фигуры гистерезисной интерференции, позволяющие повысить точность контроля структурных и магнитных свойств объектов.

Гистерезисная интерференция (*HI*) на магнитном носителе и других носителях информации впервые получена авторами и изложена, в частности, в [1; 2; 5–8; 11]. Так, в [1; 2] представлены расчеты распределений *HI* и ее использования при контроле объектов из электропроводящих матери-392 алов. Отметим одну из основополагающих работ по магнитографии [3], в которой в том числе, рассмотрены записи магнитных полей на магнитную ленту. Для определения параметров импульсов магнитного поля приняты во внимание магнитограммы поперечного намагничивания [4]. Определение нарушений сплошности с использованием пленочных флюксдетекторов осуществлено авторами и описано в [5]. При записи информации на магнитный носитель и считывании ее магнитной головкой авторами учитывается дифференциальный фон электрического сигнала датчика [6]. Распределение импульсного магнитного поля, прошедшего через металлический объект, изучено в [7]. В работе также использованы результаты работы [8], в которой получены распределения импульсных магнитных полей вблизи металлических объектов разной толщины и учтены способы контроля материалов, изложенные в [9; 10]. В [11] проведен анализ алгоритмов гистерезисной интерференции. Дополнительно выделим материалы, изложенные в [12] по применению вихретокового метода контроля.

Для поиска информации свойств объектов необходимо использовать распределения магнитных полей разных источников, в том числе источников, обусловленных структурными, магнитными и другими неоднородностями объектов.

Использование нескольких внешних источников магнитного поля одновременно на заданных участках объектов может значительно повысить уровень информации о свойствах объектов.

Таким образом, целью работы является повышение точности контроля объектов путем построения гистерезисных интерференций электрических сигналов, характеризующих ветви остаточного намагничивания магнитного носителя в импульсных магнитных полях при воздействии на объект с магнитным носителем одновременно однородным полем и полем локального источника.

Воздействуем на магнитный носитель импульсами магнитного поля двух источников и воспроизведем записанную на нем информацию с помощью магнитной головки.

Начальную остаточную ветвь применяемого МН для первого (прямого) импульса описываем найденной нами ранее [2] формулой

$$U_1 = 23,5 + 24,3 \operatorname{arctg}(0,011H_1 - 1,45).$$

Здесь электрическое напряжение U_1 выражено в милливольтах, а напряженность магнитного поля H_1 – в А/см.

При воздействии вторым (обратным) импульсом магнитного поля используем следующую остаточную гистерезисную ветвь [2]:

$$U_2 = -23,5 + 0,61U_1 + (24,3 + 0,42U_1) \times \\ \times \operatorname{arctg}((0,011 + 0,000087U_1) H_2 + 1,45 - 0,0016U_1),$$
(1)

а при воздействии третьим (прямым) импульсом используем остаточную гистерезисную ветвь (1) с соответствующими знаками перед коэффициентами.

Воздействуем на размагниченный магнитный носитель импульсами магнитного поля и получим ветви U(H), соответствующие циклам перемагничивания МН и изображенные на рис. 1. Напряженностям поля первого источника 100 А/см, -35,5 А/см и 20 А/см соответствуют суммарные напряженности двух источников 110,5 А/см, -40 А/см и 21,5 А/см.

Цикл напряжения < 1, 2, 3, 4, 5 > MH получен при напряженности импульсов источника однородного магнитного поля 100 А/см и –35,5 А/см.

Цикл напряжения < 1, 7, 8, 9, 10 > MH – при напряженности импульсов двух источников магнитного поля 110,5 А/см и –40 А/см.

Цикл напряжения < 1, 7, 8, 16, 1, 12, 13 > MH – при напряженности импульсов двух источников магнитного поля 110,5 А/см, -80 А/см и 35,5 А/см, а цикл < 1, 7, 8, 16, 1, 14, 15 > MH построен при напряженности также двух источников поля 110,5 А/см, -80 А/см и 40 А/см.

На рис. 1 показаны прямая *17* и обратная *18* начальные остаточные ветви МН, а также отрезки прямых 5–6 и 10–11.



Рис. 1. Циклы напряжения U(H), соответствующие циклам перемагничивания МН

В результате воздействия на размагниченный МН первым (прямым) импульсом поля с напряженностью 100 А/см и определенной ранее напряженностью поля второго источника 10,5 А/см переходим из 1 (рис. 1) через 2 через 3 с прибавлением этого поля в 4 и далее по отрезку прямой 5 в 6. 394

После воздействия на МН вторым (обратным) импульсом напряженностью –40 А/см переходим из 8 в 9 и далее в 10 и 11. При воздействии на МН вторым (обратным) импульсом напряженностью –80 А/см переходим через 16 в 1.

В результате воздействия одним первым импульсом из размагниченного состояния МН 1 попадаем в 12 и 13 при напряженности 35 А/см и в состояние 14 и 15 при напряженности 40 А/см.

Поскольку сигнал в точке 11 U > 0, то действие третьим (прямым) импульсом может быть результативным только при его напряженности



Рис. 2. Зависимости напряжения *U*(*x*) от расстояния *x* до проекции оси второго источника

больше 80 А/см при движении по начальной остаточной ветви 17. Это обусловлено тем, что дальнейшее увеличение намагниченности материала в одном и том же направлении возможно только при превышении напряженности магнитного поля, приведшего ранее материал в это состояние [8].

Пусть первый источник создает однородное магнитное поле, а вторым источником является линейный индуктор.

Построим картины гистерезисных интерференций U(x), где x – расстояние от проекции оси линейного индуктора на плоскость МН для разных серий импульсов. Для этого найдем зависимости U(x), еского напряжения на рис 1

соответствующие циклам электрического напряжения на рис. 1. На рис. 2 показаны зависимости *U*(*x*) при следующих воздействиях на

MH: $1 - H_1 = 100$ A/cm; $H_2 = 10,4$ A/cm; $2 - H_1 = 100$ A/cm; $3 - H_1 = 100$ A/cm; $H_2 = 10,4$ A/cm; $H_{11} = -35$ A/cm; $H_{22} = -5,6$ A/cm; $4 - H_1 = 100$ A/cm; $H_{11} = -35$ A/cm; $5 - H_1 = 75$ A/cm; $H_2 = 7$ A/cm; $6 - H_1 = 35$ A/cm; $H_{22} = 4,6$ A/cm; $7 - H_1 = 35$ A/cm.

Здесь H_1 и H_{11} – амплитуды первого и второго импульсов первого источника поля, а H_2 и H_{22} – амплитуды первого и второго импульсов второго источника. Линейный индуктор находится на расстоянии 0,6 см над объектом, его ось параллельна поверхности объекта.

На рис. 3 показаны оптические изображения магнитных полей. Изображение 1 построено с использованием кривой 1 (рис. 2) и зеркальной ей кривой, смещенной на 30,8 мВ. Изображение 2 – кривая 3 (рис. 2) и зеркальная ей кривая, смещенные соответственно на 3 мВ и 9 мВ. Изображение 3 – кривая 6 (рис. 2) и зеркальная ей кривая, усиленные в 2,1 раза с последующим смещением соответственно на -10,5 мВ и 32 мВ. Таким образом, могут быть найдены оптимальные режимы контроля объектов с учетом гистерезисных свойств как материала объекта, так и используемого магнитного носителя.



Рис. 3. Оптические изображения магнитных полей

Применение разработанных методов расчета полей позволяет повысить точность контроля магнитных и механических свойств объектов. Это достигается за счет построения гистерезисных интерференционных картин электрических сигналов, соответствующих ветвям остаточного намагничивания магнитного носителя в импульсных магнитных полях при воздействии на объект с магнитным носителем одновременно однородными полями и полями локальных источников, моделирующих поля структурных неоднородностей материала объекта. Последующая обработка результатов расчета

или измерений методами гистерезисной интерференции с построением оптических изображений магнитных полей разной конфигурации позволяет выделять любые локальные отклонения сигнала от заданного уровня, повышая тем самым точность контроля параметров объектов.

Литература

1. Pavlyuchenko, V. V. Calculating Distributions of Pulsed Magnetic Fields under Hysteretic Interference Russian Journal of Nondestructive Testing / V. V. Pavlyuchenko, E. S. Doroshevich, V. L. Pivovarov // Russian Journal of Nondestructive Testing. – 2018. – Vol. 54, № 2. – P. 121–127.

2. Павлюченко, В. В. Использование магнитного гистерезиса при контроле объектов из электропроводящих материалов в импульсных магнитных полях / В. В. Павлюченко, Е. С. Дорошевич // Дефектоскопия. – 2013. – № 6. – С. 53–68.

3. Козлов, В. С. Техника магнитографической дефектоскопии / В. С. Козлов. – Мн.: Вышэйшая школа, 1976. – 256 с.

4. Павагин, В. А. Идентификация кольцевых сварных швов на магнитограммах дефектоскопов поперечного намагничивания / В. А. Павагин, А. Ф. Матвиенко // Дефектоскопия. – 2009. – № 8. – С. 13–18.

5. Pavlyuchenko, V.V. Testing for Discontinuities in Metals Using Film Flux / V. V. Pavlyuchenko, E. S. Doroshevich // Russian Journal of Nondestructive Testing. -2019. - Vol. 55, No 1. - P. 48–58.

6. Pavlyuchenko, V. V. Differential Background of Electric Signal Readfrom an Induction Magnetic Head / V. V. Pavlyuchenko, E. S. Doroshevich // Russian Journal of Nondestructive Testing. – 2021. – Vol. 57, $N \ge 8$. – P. 706–716.

7. Pavlyuchenko, V.V. Testing for Defects in Pulsed Magnetic Field Transmitted Through Metal / V. V. Pavlyuchenko, E. S. Doroshevich // Russian Journal of Nondestructive Testing. -2021. - Vol. 57, No 10. - P. 856-864.

8. Pavlyuchenko, V. V. Pulsed Magnetic Field near Metal Surface/V. V. Pavlyuchenko, E. S. Doroshevich // Russian Journal of Nondestructive Testing. -2022. - Vol. 58, No 11. - P. 983-991.

9. Суханов, Д. Я. Магнитоиндукционный интроскоп для дефектоскопии металлических объектов / Д. Я. Суханов, Е. С. Совпель // Дефектоскопия. –2015. – № 5. – С. 56–62.

10. Шлеенков, А. С. Оценка возможности обнаружения микродефектов сварных соединений прямошовных электросварных труб, изготовленных стыковой высокочастотной сваркой, магнитным методом контроля / А. С. Шлеенков, В. Г. Бычков, О. А. Булычев, Н. М. Лядова, В. Е. Щербинин // Дефектоскопия. – 2010. – № 2. – С. 23–29.

11. Pavlyuchenko, V. V. Hysteretic Interference Algorithms / V. V. Pavlyuchenko, E. S. Doroshevich // Russian Journal of Nondestructive Testing, -2023. - Vol. 59, No. - P. 537-546.

12. Печенков, А. Н. Вихревые токи и поля проводящих и намагничивающихся шаровых включений в немагнитную среду / А. Н. Печенков, В. Е. Щербинин //Дефектоскопия. – 2016. – № 4. –С. 48–55.

УДК 620.130

Циклы напряжения датчика, соответствующие циклам перемагничивания объектов

Павлюченко В. В., Дорошевич Е. С. Белорусский национальный технический университет Минск, Республика Беларусь

Представлены циклы электрического напряжения датчика U(H), соответствующие циклам перемагничивания объекта из ферромагнитного материала. Циклы U(H), содержащие начальные и гистерезисные остаточные ветви, получены в импульсных магнитных полях с чередующейся полярностью. Воздействие на объект осуществляли полями двух источников. Построены распределения U(x) по координате x и картины гистерезисной интерференции, позволяющие повысить точность определения структурных и магнитных свойств объекта.